

## VACUUM2013 - 真空展に出展

「価値あるソリューション」をテーマに、多数の真空機器を実機展示します

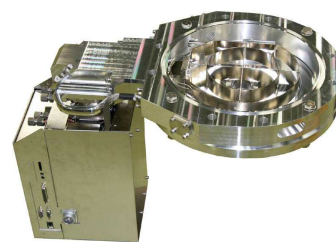
キャノンアネルバ株式会社（社長：酒井純朗、本社：神奈川県川崎市麻生区栗木2-5-1、以下：キャノンアネルバ）は、11月6日～8日の3日間、東京ビッグサイトにて開催される“VACUUM2013 - 真空展”に出展します。



ガス分析システム C シリーズ



キャパシタンスゲージ M-342DG



スターリング式冷凍トラップ SCトラップ(仮称)

### ■高精度で安定した圧力測定 隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」

圧力センサー部に新開発の小型シリコンMEMSチップを採用し、業界トップクラスのスペックを実現した新製品「キャパシタンスゲージM-342DG」を出展します。外部環境から受ける影響を最小限に抑え、繰り返し測定に強く、高精度で安定した圧力測定が可能です。2013年12月末まで、特別価格で提供する『発売開始キャンペーン』を実施中。

### ■ガス分析装置のエントリーモデル「コンパクト型ガス分析システム C シリーズ」

基本構成となる分析管、コントローラー、排気系、ガス導入系をコンパクトで軽量のフレームに搭載し、操作、メンテナンス、移動、設置などが容易に行える、「使いやすさ」を徹底的に追求したガス分析システムのエントリーモデルです。

### ■コンプレッサが不要な冷凍トラップ「SCトラップ(仮称)」 【2014年発売予定】

新開発高性能スターリング冷凍機の採用により、別置コンプレッサユニットとヘリウム配管を廃し、圧倒的な省スペースと省エネルギーを実現したクライオトラップです。2014年の発売に先んじて、プロトタイプモデルを実機展示します。

### ■クライオポンプ、ヘリウム漏れ試験機などキャノンアネルバ主力製品の実機展示

優れた省エネルギー性能を有するクライオポンプ「POWER Eco シリーズ」をはじめ、ヘリウム漏れ試験機、真空計、質量分析計、真空ポンプなどの主力製品の実機を多数展示します。

### ■VACUUM2013 - 真空展

- ・会期： 2013年11月6日(水)～11月8日(金) (<http://www.nikkan.co.jp/eve/vacuum/>)
- ・会場： 東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場) 東ホール
- ・キャノンアネルバブース： C-01番

## <主な展示品のご紹介>

### 1. 高精度で安定した圧力測定 隔膜真空計「キャパシタンスゲージ M-342DG」

- ・大気圧～低真空領域の高精度・絶対圧測定が可能な隔膜真空計。
- ・小型シリコン MEMS チップ製ダイヤフラムを採用。高精度、安定した圧力測定を実現。
- ・ゼロ点調整頻度の最小化、および電源投入後短時間で使用可能など、使いやすさを追求。
- ・現行のトランスデューサ型真空計の専用表示器「M-601GC」「M-603GC」に適合。
- ・フルスケール圧力で、13.3kPa(100torr)と 133kPa (1000torr)の2種類をご用意<sup>※1</sup>。  
※1 133Pa(1torr)、1.33kPa(10torr)は2014年にリリース予定。
- ・特別価格でご提供する『M-342DG 発売開始キャンペーン』を実施中(2013年12月まで)。



キャパシタンスゲージ M-342DG

### 3. ガス分析装置のエントリーモデル「コンパクト型ガス分析システム Cシリーズ」

- ・分析管、コントローラー、排気系(ターボ分子ポンプ+粗引きポンプ)、ガス導入系をコンパクトで軽量なフレームに搭載し、「使いやすさ」を追求したガス分析システム。
- ・用途に応じて構成内容の選択が可能で、各種測定に対応可能。
- ・スイッチ一つで排気制御が可能。排気/測定用インターロック機能を搭載。
- ・フットプリント約 480mm×500mm で省スペース。
- ・真空計、ヒーターなどをオプションで設置可能(写真はPCを設置した状態)。



ガス分析装置 Cシリーズ

### 3. コンプレッサが不要な冷凍トラップ「SCトラップ(仮称)」【2014年発売予定】

- ・新開発高性能スターリング冷凍機の採用により、別置コンプレッサユニットとヘリウム配管を廃し、圧倒的な省スペースと省エネルギーを実現したクライオトラップ。
- ・水分に対する高い排気速度と、高コンダクタンスを両立し、ターボ分子ポンプと併用することで排気性能向上を実現。
- ・メンテナンスサイクルが長く、ランニングコスト低減にも貢献。



スターリング式冷凍トラップ SCトラップ(仮称)

#### 4. 海外使用可能な上位互換モデル イオンポンプ/ノーブルポンプ用制御装置 「P-500 シリーズ」

- ・電子顕微鏡や加速器などで使用される超高真空ポンプ「イオンポンプ/ノーブルポンプ」用の小型制御装置。
- ・視認性の高い緑色の大型 LED ディスプレイを搭載。デジタルバーグラフによる出力電流、出力電圧、圧力(真空度)の表示が可能。
- ・キャノンアネルバ製イオンポンプの現行ラインナップに対応。
- ・RoHS 指令、CE マーキングに適合し、マルチ入力電圧仕様 (AC100~240V 50/60Hz 単相) で海外での使用が可能。
- ・当社従来製品“PIC シリーズ”とリモートコネクタ、入力・出力ケーブルの互換性があり、容易に置き換えが可能。



イオンポンプ/ノーブルポンプ用制御装置 P-500 シリーズ

#### 5. Edwards 社製真空ポンプ 【キャンペーン実施中】

- ・加圧給油方式を採用し、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えるオイル逆流防止機構付きのロータリーポンプ「RV シリーズ」。
- ・性能、信頼性およびユーザーでの使いやすさを提供する最高レベルの理科学分野向けターボ分子ポンプ「nEXT シリーズ」。
- ・優れた排気速度と最高度の真空到達圧力を備え、クラス最高のパフォーマンスを提供するスクロールドライポンプ「nXDS シリーズ」。
- ・背圧ポンプを 2 種類から選択可能な高真空排気ユニット「T-Station75」。
- ・エドワーズ株式会社との販売代理店契約締結を記念し、弊社より過去ご購入戴いた、ロータリーポンプをエドワーズ社製ロータリーポンプへ置換える『置換えキャンペーン』を実施中 (2013 年 12 月まで)。



ロータリーポンプ RV シリーズ



ターボ分子ポンプ nEXT シリーズ



スクロールドライポンプ nXDS シリーズ



ターボ排気ユニット T-Station75

## <ロングセラー製品>

### 6. 優れた省エネルギー性能 クライオポンプ「POWER Eco」シリーズ

- ・省エネルギーの観点から、消費電力や冷却水量を低減することを目的として開発された高性能省エネルギー型のクライオポンプ。
- ・実用性に優れたポンプの起動特性とマルチ運転時の温度安定性。
- ・自己発熱機能や独自の排気パネル構造により、ヒーター無しで高速再生が可能。



クライオポンプ POWER Eco シリーズ

### 7. 大気圧～超高真空の測定が可能「トランスデューサ型真空計」シリーズ

- ・「クリスタルイオンゲージ」「コールドカソードピラニゲージ」「イオンゲージ」「キャパシタンスゲージ」「ピラニゲージ」の5機種をラインナップし、各種の測定圧力領域や用途に対応。
- ・電源部とセンサー部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。
- ・大型カラーLCDパネル付表示器「M-603GC」(別売)では真空計3台の同時モニタリングが可能。



クリスタルイオンゲージ M-336MX



3チャンネル表示器 M-603GC

### 8. 着脱式ハンドコントローラー付 ヘリウム漏れ検知機「HELEN (ヘレン)」

- ・本体から着脱可能なカラー液晶パネル付ハンドコントローラーを標準装備。最大8mまで伸びるコード付きで、使いやすさに優れ、大型装置などの漏れ試験にも対応。
- ・重さ42kgで可搬性に優れたM-212LD、および大型粗引きポンプを装備したM-222LD、スニファー法<sup>※2</sup>専用タイプのM-232LDを展示予定。



ヘリウム漏れ検知機 M-222LD

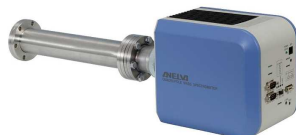


着脱式ハンドコントローラー

※2 (ヘリウム漏れ試験について) 試験体内部をヘリウム漏れ検知機内蔵の真空ポンプで排気し、外側からヘリウムを吹きかけて漏れ検知機で検知する「真空吹付法」の他、試験体内部をヘリウムで加圧し、外側に漏れてくるヘリウムをプローブで吸い込み検知する「スニファー法」などの試験方法があります。

## 9. 分析管・電源部一体型質量分析計「トランスデューサ型マスフィルタ」

- ・分析管と電源部が一体化したトランスデューサ型のため、電源据置き型と比較して省エネルギー、省配線、省スペース。装置への取付けも容易。
- ・ガス組成のモニタにより、システム不具合解析やプロセススタート条件の確認に貢献。
- ・操作も容易な専用ソフトウェア「QUADVISION」を標準添付（日本語版または英語版）



トランスデューサ型マスフィルタ

## 10. その他の出展製品

- ・ $10^{-9}$ Pa 台の排気が可能な超高真空ポンプ「イオンポンプ」
- ・バルブ、フランジなど超高真空対応の配管部品を多数展示

### <キャノンアネルバについて>

キャノンアネルバはキャノン株式会社の100%子会社であり、真空技術を基幹技術とした真空薄膜形成装置や真空部品の開発・製造・販売を行なっています。真空薄膜形成装置の中でもスパッタリング方式の装置を多くラインナップし、ハードディスクの磁気ヘッドおよび磁気ディスク製造用スパッタリング装置では世界トップシェアを有し、関連技術において「内閣総理大臣賞(産学官連携功労者表彰)」「井上春成賞」「市村産業賞・貢献賞」などの受賞歴があります。また、最近ではスマートデバイス市場向けの各種高性能デバイス製造ラインに多数の製造装置を提供し、スマートデバイスの普及・モバイルシーンの拡大に寄与しています。2012年度売上高は371億円。

真空展には毎年継続して出展しており、真空コンポーネント製品中心の展示を行なっています。この度、キャノンアネルバの真空コンポーネント販売部門は、同フィールドサービス部門と統合いたしました(2013年8月19日付)。サービス部門と一体となることでお客様とより深いリレーションを築きながら、様々なお声を頂戴し、販売、サービス、そして製品の質の向上に努めてまいります。